

## セラミックス粒子集積膜の SAXS によるマクロ構造解析

神谷 和孝、杉山 武晴、西堀麻衣子、寺岡 靖剛

九州大学シンクロトロン光利用研究センター

機能性セラミックス粒子集積膜を用いる化学センサの性能は、粒子径や粒子配列により形成される空隙などのマクロ構造に大きく影響される。セラミックス粒子の評価には、表面形態観察の SEM や細孔分布測定の BET 法が用いられるが、粒子集積膜のマクロ構造を解析するには適していない。そこで、本研究では小角 X 線散乱 (SAXS)によるセラミックス粒子集積膜のマクロ構造解析手法を確立することを目的とし、様々な配列状態の粒子集積膜の測定を行った。

本研究でモデル材料として用いた  $\text{SiO}_2$  単分散粒子の SAXS プロファイルから、粒子径 117 nm (カタログ値 110 nm) と見積もることができた。 $\text{SiO}_2$  単分散粒子スラリーをガラス基板上に滴下し配列規則性の異なる  $\text{SiO}_2$  集積膜を作製した。最も規則性の高い  $\text{SiO}_2$  集積膜では粒子径 117 nm の単分散粒子のプロファイルに加え  $q = 0.07$  付近にピークが確認でき、解析により中心径 28 nm と見積もることができた。この値は粒子径 117 nm の  $\text{SiO}_2$  粒子が最密充填した場合に形成される粒子間空隙の直径に等しく、集積膜中の  $\text{SiO}_2$  粒子が規則的に配列していることを示していると考えられる。 $\text{SiO}_2$  粒子配列の規則性が低い集積膜では  $q = 0.07$  付近のピーク強度が減少しており、このピーク強度が配列の規則性に依存することが分かった。これらの結果は、セラミックス粒子集積膜の SAXS 測定により粒子配列の規則性を評価できることを示唆する。

# セラミックス粒子集積膜のSAXSによるマクロ構造解析

神谷 和孝、杉山 武晴、西堀麻衣子、寺岡 靖剛  
九州大学シンクロトロン光利用研究センター

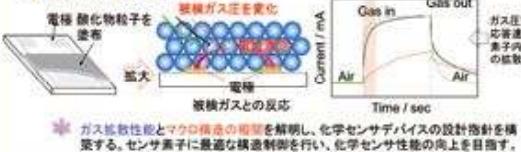
## はじめに

### 化学センサ素子の設計指針

- ① 粒子径制御
- ② マクロ構造制御(成膜)
- ③ マクロ構造解析
- ④ 素子内部のナノサイズの親和性など
- ⑤ センシング特性評価
- ⑥ ガス拡散性および反応性評価



### \*ガス拡散性評価



\*ガス拡散性とマクロ構造の関係を解明し、化学センサの設計指針を構築する。センサ素子に最適な構造制御を行い、化学センサ性能の向上を目指す。

### 目的

本研究では小角X線散乱(SAXS)によるセラミックス粒子集積膜のマクロ構造解析手法を確立することを目的とし、様々な配列状態の粒子集積膜の測定を行った。

## 実験方法

### シリカ粒子集積膜の調製方法

#### 粒子分散スラリーの調製

粒子 + 液媒(水) + 分散剤(界面活性剤)

超音波処理10 min

#### 粒子分散スラリー

カバーガラス基板上に滴下(厚さ: 120 μm)

室温で乾燥(24 h)

#### 粒子集積膜

SEM観察

SAXS実験 九州大学ビームライン(SAGA-LS/BL06)

サンプル名	液媒	分散剤	粒子
SiO <sub>2</sub> 粒子	なし	なし	SiO <sub>2</sub> 粒子(粒径: 110 nm)
SiO <sub>2</sub> 粒子集積膜H0	水	F-127	SiO <sub>2</sub> 粒子(粒径: 110 nm)
SiO <sub>2</sub> 粒子集積膜L0	水	F-127	SiO <sub>2</sub> 粒子(粒径: 110 nm)
PS粒子	なし	なし	PS粒子(粒径: 100 nm)
PS粒子集積膜	水	P-123	PS粒子(粒径: 100 nm)

### \*セラミックス粒子集積膜のSAXSを利用したマクロ構造解析

#### \*センサ素子作成

Direct beam

Detector(IP)

sample

散乱ベクトルに  
対して積分

Detector(IP)

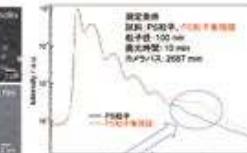
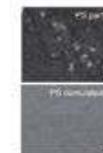
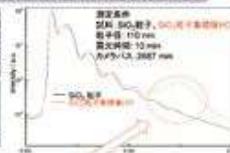
q<sub>z</sub>

q<sub>x</sub>

形状由来  
散乱

粒子と異なるピークよりセラミックス粒子  
の配列性、規則性(マクロ構造)を評価。

### 粒子と規則配列させた粒子集積膜の比較

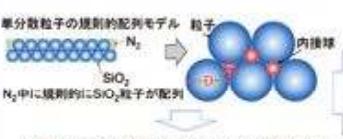


◎ SiO<sub>2</sub>粒子集積膜のSAXSプロファイルでは、q = 0.07付近に粒子のプロファイルで観察されないピークが観察される。

↓

◎ q = 0.07付近に存在するピークは物質依存ではなく、粒子の配列規則性に依存する構造因子由来の散乱であると考えられる。

### SAXS Fitting model of cumulated film



单分散粒子の規則的配列モデル 粒子  
N<sub>2</sub>中に規則的にSiO<sub>2</sub>粒子が配列  
内接球

N<sub>2</sub>中に規則的にSiO<sub>2</sub>粒子が配列

上記の2項が必要と考えられる。

#### フィッティング式(2成分フィッティングモデル)

$$I(q) = \int_0^\infty [F(q, R)]^2 S(q) P_M^M(R) / \pi R^2 dR + \int_0^\infty [F(q, R_{SiO_2})]^2 S(q) P_M^M(R_{SiO_2}) / \pi R_{SiO_2}^2 dR$$

散乱体にSiO<sub>2</sub>、母材にN<sub>2</sub>の項 散乱体にN<sub>2</sub>、母材にSiO<sub>2</sub>の項

F(q): 形状因子 R: 球の半径

S(q): 構造因子 M: 分布関数

P(R): 分布関数 R<sub>0</sub>: 平均粒子サイズ

$$F(q) = \int_p \Delta\rho(r) e^{iqr} dr : \Delta\rho(r) : 電荷密度差$$

$$S(q) = 1 + \int_p (n(r) - n_0) e^{iqr} dr : n(r) : 粒子充填率$$

### 单分散球状粒子のフィッティングモデル

N<sub>2</sub> X線の散乱体に  
SiO<sub>2</sub>粒子のみ

N<sub>2</sub>中にランダムに存在  
散乱体にSiO<sub>2</sub>、母材にN<sub>2</sub>

下記のフィッティング式により解析

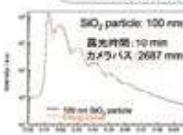
#### フィッティング式

$$I(q) = \int_0^\infty [F(q, R)]^2 S(q) P_M^M(R) / \pi R^2 dR$$

F(q): 形状因子 R: 球の半径

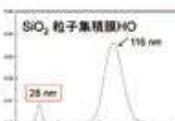
S(q): 構造因子 M: 分布関数

P(R): 分布関数 R<sub>0</sub>: 平均粒子サイズ



○ 単分散球状粒子モデルだけ  
では、シリカ粒子集積膜の  
解析は困難である。

### SAXS analysis with binary fitting model



直後の単分散球の最高充填時に  
内接できる球の直径aは

a = 0.225Dである。

○ 解析により得られた空間の直径aは、  
直徑Dの粒子間の空間に  
できる内接球の直徑に等しい。

### シリカ粒子配列規則性の比較

#### SiO<sub>2</sub>粒子集積膜作成スラリー条件

SiO<sub>2</sub>粒子集積膜L0: SiO<sub>2</sub>粒子(100 nm) 10 mg + water 10 ml + F-127 0.1 mg

SiO<sub>2</sub>粒子集積膜H0: SiO<sub>2</sub>粒子(100 nm) 10 mg + water 10 ml + F-127 0.15 mg

SEM image of SiO<sub>2</sub> particle accumulation film L0

SEM image of SiO<sub>2</sub> particle accumulation film H0



直後の単分散球の最高充填時に  
内接できる球の直径aは

a = 0.225Dである。

○ 単分散球の最高充填時に  
内接できる球の直径aは

a = 0.225Dである。



直後の単分散球の最高充填時に  
内接できる球の直径aは

a = 0.225Dである。

○ 単分散球の最高充填時に  
内接できる球の直径aは

a = 0.225Dである。

規則因子S(q)の解析により得られる粒子充填率, η

$$\eta = \pi n_0 R^3 / 6$$

サンプル名 粒子充填率

SiO<sub>2</sub>粒子 30%

SiO<sub>2</sub>粒子集積膜L0 43%

SiO<sub>2</sub>粒子集積膜H0 58%

○ 配列規則性が高いほど、粒子充填率が増加する。

○ 配列規則性から得られる粒子充填率は、粒子配列性の評価指標となることを示唆する。

## まとめ及び考察

○ PS粒子、SiO<sub>2</sub>粒子集積膜ともにq = 0.07付近にピークが存在し、粒子の配列規則性に依存するピークであると考えられる。

○ 最も規則性の高いSiO<sub>2</sub>集積膜では粒子径117 nm の单分散粒子のプロファイルに加えq = 0.07付近にピークが確認でき、解析により中心径28 nmと見積もることができた。

○ SiO<sub>2</sub>粒子配列の規則性が低い集積膜ではq = 0.07付近のピーク強度が減少しており、このピーク強度が配列の規則性に依存することが分かった。

○ これらの結果より、セラミックス粒子集積膜のSAXS測定により粒子配列の規則性を評価できることを示唆する。

## 謝辞

本研究のSAXSの実験は、九州大学ビームライン(SAGA-LS/BL06)にて、課題番号2012IK006、2012IK004、2012IK001、2013IKN003で実施した実験である。